

紫外可視近赤外対象の光散乱特性評価分光装置

LOT-4AXIS-UVNIR



紫外・可視・近赤外対象の光散乱特性評価分光装置「LOT-4AXIS-UVNIR」

従来測定が困難とされていましたがBSDF測定を**分光装置**で行えます。

装置概要

θ軸2軸・β軸2軸の自動ステージによるサンプルの反射及び透過スペクトルの測定
BSDF測定（BRDF測定とBTDF測定）

製品仕様

対象波長	280nm～980nm (分光装置単体：190nm～980nm)
波長分解能	2.4nm (typ)
波長精度	0.3nm以下
S/N比	10000 : 1
校正波長範囲	200nm～800nm(キセノン) 380nm～980nm(ハロゲン)
回転ステージ稼働範囲	反射 β軸 出射部：0°～180° β軸 受光部：0°～±90° θ軸 受光部：0°～±90° θ軸 サンプル設置部：0°～±90° 透過 β軸 出射部：0°～180° β軸 受光部：180°～+90°,-90.1° θ軸 受光部：0°～±90° θ軸 サンプル設置部：測定時において各ステージが干渉しない角度範囲
回転ステージ精度	0.1°(位置決め精度) 0.008°(繰り返し精度)
測定サンプルサイズ	5cm x 5cm
入射スポットサイズ	φ2mm～φ10mmの中から選択
受光径	φ11.3mm固定
実測値→計算算出値	光度・放射輝度→輝度・放射輝度
装置外形及び重量(参考値)	約W1500×D1500×H1850 (mm)、350kg以下

Webでは測定動画
も見られます

